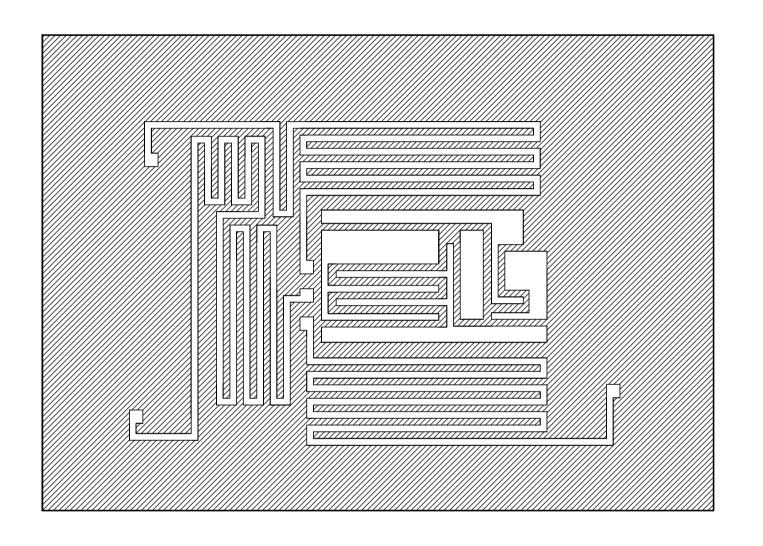
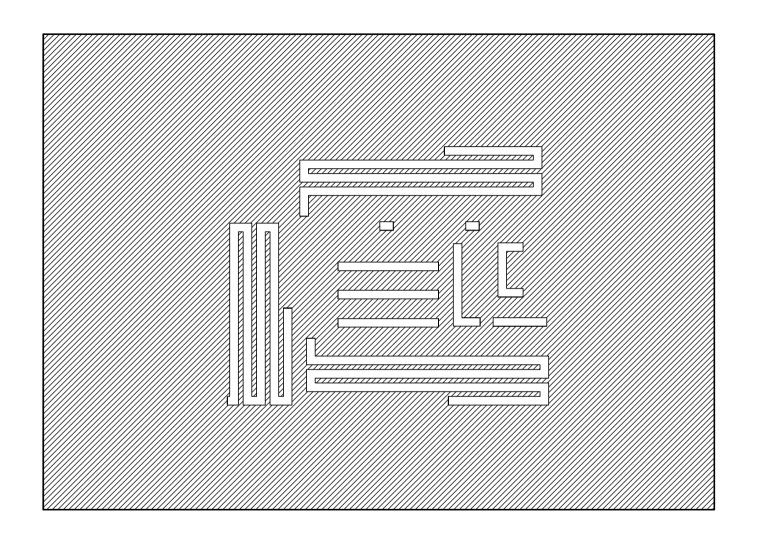


Nº	Шар	Матеріал	Товщина, мкм
1	Підкладка	<i>ΚΕΦ-3</i>	120
2	Товстий діелектрик	SiO₂	1,0
3	Дифузійні області	p∸Si	1,0
4	Область підлегування	П	0,5
5	Підзатворний діелектрик	SiO ₂	0,05
6	Металізація	Αl	1,2
7	Пасивація	Φίί	1,0

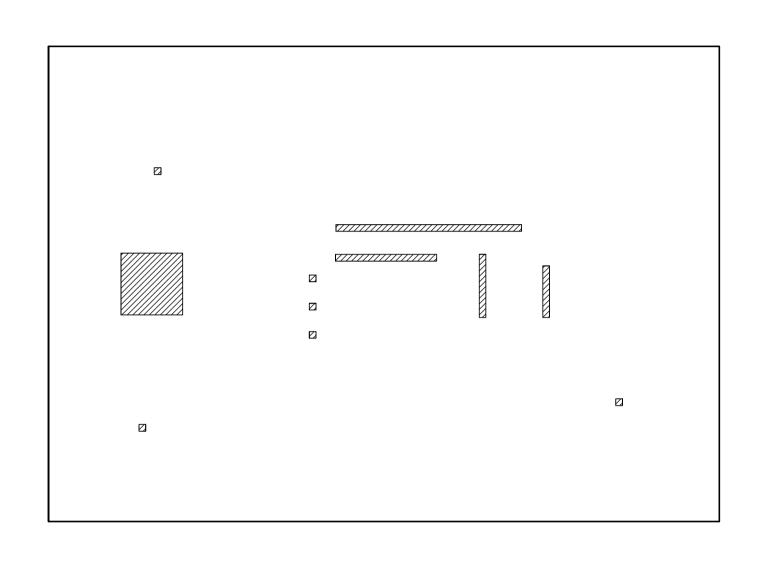
					ДП82.8211.022.001.ТК						
					Літ. Маса)						
Зм.	/lim.	№ докум.	Підпис	Дата] [П					
Розроб.		Лищенко			Топологічне креслення		K		800:1		
Пер	оевір.	Королевич									
Т.конт.						Арі	куш	1 Аркуц	υίβ 2		
						НТУУ "КПІ", кафедра			едпа		
Н.конт.											
Зап	пверд.					PHF	мікроелектроніки				



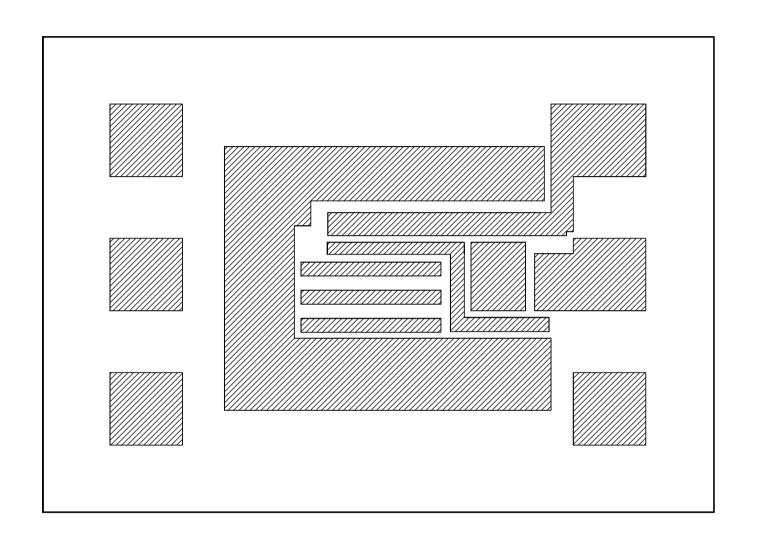
					ДП82.8211.022.001.ФШ						
						/lim.	Маса	Масштаδ			
Зм.	/lim.	№ докум.	Підпис	Дата							
Po	эгроδ.	Лищенко			Φοπουιαδлοн	K		500:1			
Пе	ревір.	Королевич									
T.,	конт.					Аркуш	1 Аркуц	иів 5			
						НТУУ "КПІ", кафедра		едпа			
Н.конт.					фотолітографія №1	мікроелектроніки					
3а г	тверд.					мікроелекіііроніка					



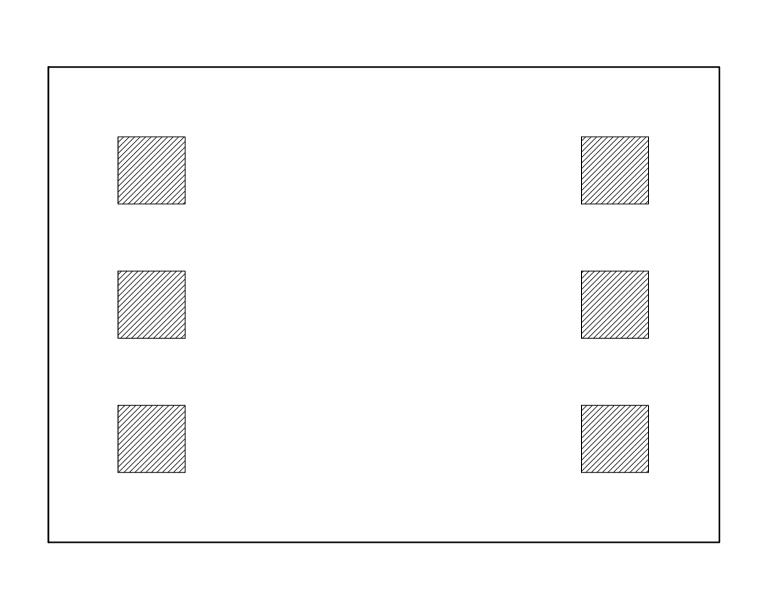
					ДП82.8211.022.001.ФШ						
							/lim		Маса	Масштаδ	
Зм.	/lim.	№ докум.	Підпис	Дата		Г					
Розроб.		Лищенко			Фотошаблон	ı	$ \kappa $			500:1	
Пе	ревір.	Королевич				L					
Τ.	конт.					Αſ	жу	И	2 Аркуц	<i>μiβ</i> 5	
						НТУУ "КПІ", кафедра					
Н.конт.					фотолітографія №2						
Заг	тверд.				' '		мікроелектроніки				
_			-	-							



					ДП82.8211.022.001.ФШ						
						/lim. Maca				Масштаδ	
Зм.	/lim.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроδ.		Лищенко			Фотошаδлон		$ \kappa $			500:1	
Перевір.		Королевич									
Т.конт.						Αſ	куи	<u>.</u>	? Аркуц	uiβ 5	
						НТУУ "КПІ", кафедра			edna		
Н.конт.					фотолітографія №3		1 ' ' '				
Зап	пверд.				<i>τ</i> 3 <i>ρ</i> α <i>φ</i> , , , , ,		мікроелектроніки				



					ДП82.8211.022.001.ФШ						
						/lin	7.	Маса	Масштаδ		
Зм.	/lim.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб. Перевір.		Лищенко			Фотошаδлон	lκ	$ \kappa $		500:1		
		Королевич									
Т.,	конт.					Аркц			uiβ 5		
						НТУУ "КПІ", кафедра			eguu		
Н.конт.					фотолітографія №4		мікроелектроніки				
Заг	пверд.					<i>тікроелекіпроніка</i>					



					ДП82.8211.022.001.ФШ						
						/lim.	Маса	Масштаδ			
Зм.	/lim.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Лищенко			Фотошаблон	$ \kappa $		500:1			
Перевір.		Королевич									
Т.конт.						Аркуш	5 Аркуи	uiß 5			
					НТУУ "КПІ", кафедра						
Н.конт.					фотолітографія №5	мікроелектроніки					
Зап	пверд.				• •	мікроелекінроніка					